

共用施設ネットワーク Open research facilities

概要

TIAの中核5機関である産総研、NIMS、筑波大学、KEK、東京大学では、ナノテクノロジー研究を支える数々の最先端施設、装置を共用施設として公開しています。

A portion of leading-edge facilities and equipment for materials synthesis, microfabrication, prototype device fabrication, physical property measurement and nanoscale measurement and analysis in five core organizations of TIA (AIST, NIMS, The University of Tsukuba, KEK and The University of Tokyo) are open to the public as open research facilities.

TIAの共用施設ネットワーク (Open research facilities)

東京大学
国立大学法人 東京大学
The University of Tokyo
ナノテクノロジープラットフォーム
Nanotechnology Platform
微細構造解析
Microstructural Characterization
微細加工

提供 KEK
高エネルギー加速器研究機構 (KEK)
High Energy Accelerator
Research Organization
放射光科学研究施設
Photon Factory (PF)

国立大学法人 筑波大学
The University of Tsukuba
マルチタンデム加速器施設
Multi-Tandem Electrostatic Accelerators
ナノテクノロジープラットフォーム (微細加工)
Nanofabrication Platform
ナノサイエンスプロジェクト共用装置
Nano-Science Project Facilities

筑波大学
物質・材料研究機構 (NIMS)
ナノテクノロジープラットフォーム
Nanotechnology Platform
微細構造解析 (Microstructural Characterization
Platform for Advanced Nanomaterials)
微細加工 (Nanofabrication Platform)
分子・物質合成 (Molecule & Material Synthesis
Platform)

産総研
産業技術総合研究所 (AIST)
スーパークリーンルーム
Super Clean Room

産業技術総合研究所 (AIST)
先端ナノ計測施設 (ANCF)
ナノプロセッシング施設 (NPF)
超伝導アナログデジタルデバイス開発施設
(CRAVITY)

産業技術総合研究所 (AIST)
MEMS研究開発拠点

400台以上の共用研究装置 (5機関)
More than 400 open research apparatuses (5 institutes) in TIA

装置紹介 (Introduction of equipment)

成膜装置 Deposition system (examples)



原子層堆積装置



スパッタリング装置



プラズマCVD装置

微細加工装置 Microfabrication System (examples)



マスクレス露光装置



微細組織三次元
マルチスケール解析装置



FIB-SEM

計測・観測装置 Measurement apparatus (examples)



ヘリウムイオン顕微鏡



太陽電池欠陥評価装置



1MVタンデロン実験室



レーザー加熱超高压X線複合実験
ステーション



六軸X線回折計用実験
ステーション